

2020 年度 CUPAL 事業による放射光分析初級/中級コース(第4回)

－X 線イメージング－

日時：2021 年 3 月 25 日(木)10:15～16:00

場所：高エネルギー加速器研究機構(KEK)放射光実験施設

■午前

場所：PF 研究棟 2 階会議室

10:00～10:15 受付

10:15～10:30 ガイダンス 平野馨一

10:30～10:45 講義1 「放射光と Photon Factory について」 平野馨一

10:45～11:15 講義2 「X 線トポグラフィーについて」 杉山弘

11:15～11:45 講義3 「X 線位相イメージングについて」 平野馨一

■午後

場所：放射光実験施設(フォトンファクトリー)

13:00～13:30 実験ホールへの入域手続き(必要な方のみ、光源棟安全ビデオ受講)

13:30～14:30 ビームライン実習1 「X 線トポグラフィー」 杉山弘

14:30～14:45 休憩

14:45～15:45 ビームライン実習2 「X 線位相イメージング」 平野馨一

■連絡先：CUPAL 事務局

伴 弘司 (居室)029-864-5634(PHS)029-864-5200(4949)

中山光昭 (居室)029-864-5298

■備考

COVID-19 の状況によっては開催を中止・延期する場合がありますので、了承のほどお願い申し上げます。

■受講料：無料

■募集定員：8 名

■申込締切：2021 年 2 月 15 日(月)

■申し込み方法：件名を「CUPAL X 線イメージング研修申し込み」として氏名、所属、役職または学年、放射光実験施設経験の有無を記載して下記アドレス宛にお送りください。

kek-cupal@pfiqst.kek.jp